

## ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ФОТОПРОВОДИМОСТЬ В $Pb_{1-x}Sn_xTe:In$

И.И.Засавицкий, А.В.Матвеенко, Б.Н.Мациоашвили, В.Т.Трофимов

Обнаружена отрицательная фотопроводимость (ОФП) в эпитаксиальных слоях  $Pb_{1-x}Sn_xTe$  ( $x \approx 0,22$ ), легированных In ( $5 \cdot 10^{17} - 3 \cdot 10^{19}$  атомов в  $\text{см}^{-3}$ ). ОФП наблюдается при низких ( $\lesssim 30$  К) температурах в условиях фоновой подсветки. Обсуждается кинетика ОФП в рамках модели ян-теллеровского центра.

Высокая фоточувствительность была обнаружена в кристаллах  $Pb_{1-x}Sn_xTe$  ( $x \approx 0,2$ ) с большим содержанием In<sup>1</sup>. В данной работе сообщается о наблюдении как положительной фотопроводимости (ПФП), так и ОФП в эпитаксиальных слоях  $Pb_{1-x}Sn_xTe$ , легированных In до концентраций  $N \sim 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ . Как раз при таком уровне легирования в этом материале наблюдалось резкое уменьшение интенсивности фотолюминесценции<sup>2</sup>.

Высококачественные эпитаксиальные слои  $Pb_{1-x}Sn_xTe:In$  ( $x = 0,22 - 0,23$ ) толщиной  $d = 0,5 - 4$  мкм выращивались методом горячей стенки и методом мгновенного испарения в вакууме на подложках (111)  $BaF_2$ . В первом методе легирование проводилось путем диффузии, во втором – в процессе роста. Концентрация атомов In варьировалась от  $5 \cdot 10^{17}$  до  $3 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ . Концентрация и подвижность носителей тока при 77К составляли соответственно  $\sim 10^{18} \text{ см}^{-3}$  и  $10^4 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$  для слоев *p*-типа и  $(6 - 8) \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$  и  $3 \cdot 10^4 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$  для слоев *n*-типа, легированных In. Возбуждение фотопроводимости (ФП) осуществлялось импульсным лазером на GaAs ( $\lambda \approx 0,9$  мкм,  $\tau_{\text{имп}} = 0,1$  мкс). Образцы помещались на хладонопроводе криостата с регулируемой температурой ( $T$ ). Напряженность электрического поля в образце составляла около 0,1 В/см.

В нелегированных и легированных до уровня  $N \approx 10^{18} \text{ см}^{-3}$  образцах наблюдалась слабая ПФП, и время ее релаксации составляло  $\leq 0,2 \text{ мкс}$ . При увеличении  $N$  до  $2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$  сигнал ФП возрастал более чем на два порядка, и в условиях подсветки фоном ( $T \approx 300 \text{ K}$ ) знак сигнала ФП зависел от  $T$ . В интервале температур  $7 - 27 \text{ K}$  была обнаружена ОФП — увеличение сопротивления при фотовозбуждении. На рис. 1 приведены формы сигнала фотоответа для образца с  $N \approx 2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$  при различных  $T$ . При повышении  $T$  видна смена знака сигнала ФП с отрицательного (рис. 1, a) на положительный (рис. 1, e). При этом время релаксации ОФП несколько уменьшается, а ее амплитуда сначала увеличивается, а затем резко уменьшается до нуля. При  $T \approx 25 \text{ K}$  на фронте ОФП появляется положительный выброс, который при дальнейшем повышении  $T$  поглощает отрицательную часть сигнала. При  $T > 27 \text{ K}$  наблюдается только ПФП. Сигнал ПФП имеет два явно выраженных времени релаксации; короткое  $\tau \lesssim 0,2 \text{ мкс}$  и длинное  $\tau \lesssim 1 \text{ мс}$ .

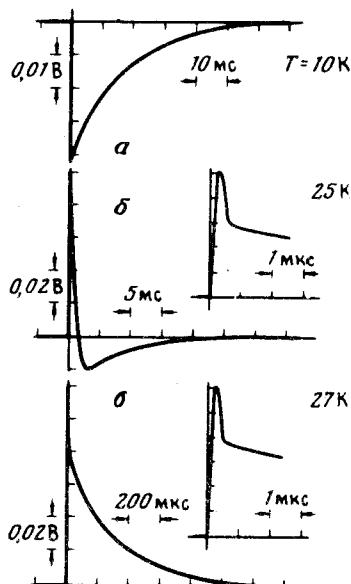


Рис. 1. Форма сигнала фотоответа для образца с  $N \approx 2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$  и  $d = 2,5 \text{ мкм}$

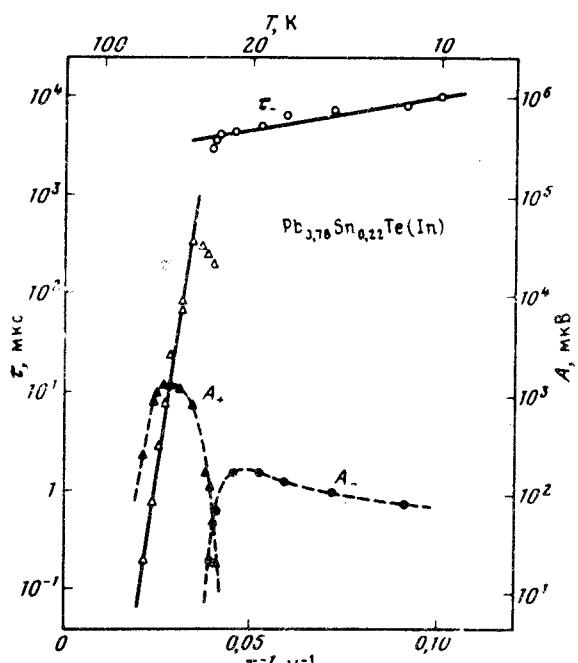


Рис. 2

Рис. 2. Зависимость времени релаксации и амплитуды фотоответа от температуры для ПФП ( $\tau_+$ ,  $A_+$ ) и ОФП ( $\tau_-$ ,  $A_-$ ).  $N = 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ,  $d = 2,0 \text{ мкм}$

На рис. 2 приведена зависимость времен релаксации ОФП ( $\tau_-$ ) и ПФП ( $\tau_+$ ) и амплитуды фотоответа ( $A_-$  и  $A_+$ ) для образца с  $N \approx 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$  в условиях фоновой подсветки. Видно, что время релаксации ПФП имеет термоактивационный характер. Энергия активации уменьшается от 51 мэВ для образцов с  $N \approx 2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$  до 35 мэВ для образцов с  $N \approx 3 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ .

На рис. 3 приведена зависимость температуры перехода ( $T_{\Pi}$ ) от ОФП к ПФП для образцов с различным уровнем легирования.  $T_{\Pi}$  уменьшается от 27 К при  $N \approx 2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$  до 17 К при  $N \approx 3 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ .

Для выяснения влияния фона изучалась кинетика ФП в условиях полного экранирования фона. В этом случае при изменении  $T$  от 8 до 200 К наблюдалась только ПФП; при этом время релаксации убывает от 10 мс до 0,2 мкс. При одновременном облучении образца излучением GaAs-лазера и глобара ( $\lambda = 3,7 - 5,5 \text{ мкм}$ ) в случае ОФП наблюдалось уменьшение времени релаксации от 10 до 0,5 мс и небольшое увеличение амплитуды, а в случае ПФП

— резкое уменьшение амплитуды и слабое уменьшение времени релаксации. При  $T > 50$  К подсветка глобаром слабо влияет на сигнал фотоответа. Измерялась также ОФП при возбуждении лазером на СО ( $\lambda \approx 5,3$  мкм,  $\tau_{имп} \approx 1$  мкс). В интервале температур 2–77 К наблюдается только ПФП. При  $T > 27$  К зависимость времени релаксации от  $T$  совпадает с зависимостью, полученной при возбуждении GaAs-лазером. При  $T < T_n$  отношение сопротивлений образца без фона и с фоном возрастало с увеличением  $N$  и составляло два порядка при  $N \approx 10^{19}$  см<sup>-3</sup>.

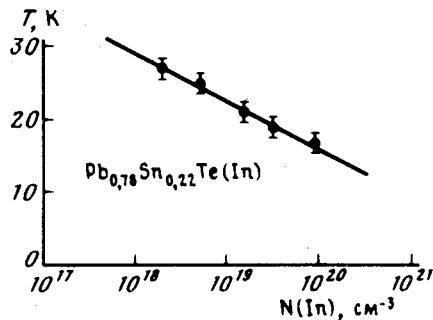


Рис. 3. Зависимость температуры перехода от ОФП к ПФП от уровня легирования In

Полученные результаты в отличие от работы <sup>3</sup> можно качественно объяснить с помощью модели яна-теллеровского центра (ЯТЦ) <sup>4</sup>. Таким центром может быть вакансия Тe или комплекс атом In — вакансия Тe. Введенный In замещает вакансию металла, являющуюся основным типом точечных дефектов в  $Pb_{0,78}Sn_{0,22}Te$ , и по мере увеличения уровня легирования происходит понижение концентрации дырок, а затем — инверсия типа проводимости при  $N \approx 2 \cdot 10^{18}$  см<sup>-3</sup>. Такой материал обладает максимальным квантовым выходом излучения по сравнению с нелегированным или сильно легированным материалом <sup>2</sup>. ЯТЦ образует локальный уровень, находящийся выше дна зоны проводимости. При захвате электрона на этот уровень происходит ян-теллеровская перестройка кристаллического окружения центра, в результате уровня с захваченным электроном опускается ниже дна зоны проводимости. Вывести электрон из этого состояния можно с помощью термической активации или фотовозбуждением. Поскольку оптические переходы происходят при неизменной конфигурации ЯТЦ, то энергия термической активации меньше, чем энергия оптического перехода.

При  $T < T_n$  электроны, заброшенные в зону проводимости фоновым излучением с ЯТЦ, не могут вернуться обратно из-за наличия потенциального барьера  $\Delta E$ . При этом сопротивление образца мало. При поглощении кванта излучения с энергией большей, чем расстояние от вершины валентной зоны до уровня ЯТЦ ( $\lambda < 5,3$  мкм), происходит захват электрона на уровень с последующей быстрой перестройкой ЯТЦ. Образовавшиеся дырки рекомбинируют с электронами зоны проводимости за время  $< 10^{-7}$  с, при этом сопротивление образца увеличивается, наблюдается ОФП. Релаксация ОФП происходит за счет фонового излучения. Действительно, увеличение интенсивности фона подсветкой глобаром ускоряет процесс релаксации ОФП.

Полное экранирование фона приводит к ликвидации механизма релаксации ОФП. В результате каждый импульс лазерного излучения будет переводить электроны на ЯТЦ, пока прямые и обратные переходы под действием излучения не уравновесят друг друга. Это приведет лишь к изменению установленвшегося значения сопротивления. В промежутке между импульсами часть электронов релаксирует через барьер  $\Delta E$ . При этом наблюдается ПФП с временем релаксации  $\sim 10$  мс при  $T = 4,2$  К. Этот процесс соответствует начальному участку релаксации долговременной ФП. Минимальное время релаксации, приведенное в <sup>5</sup> и объяснявшееся захватом на поверхностные центры, составляло  $\sim 10^2$  с. Согласно модели ЯТЦ время релаксации сильно зависит от положения уровня Ферми относительно потенциального барьера и возрастает по мере релаксации электронов из зоны проводимости на ЯТЦ.

При  $T > T_{\text{п}}$  электроны переходят на уровень ЯТЦ через потенциальный барьер  $\Delta E$  в результате термической активации. Под действием лазерного излучения электроны возвращаются в зону проводимости с последующей релаксацией через потенциальный барьер  $\Delta E$ , что приводит к ПФП, при этом время релаксации носит термоактивационный характер с энергией активации  $\approx 35 - 51$  мэВ.

Таким образом, наблюдавшиеся ОФП и ПФП в  $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te: In}$  объясняются в рамках модели<sup>4</sup>. ОФП с этой точки зрения является тушением ФП, возбужденной фоновым излучением. Для указанной модели оценена величина потенциального барьера  $\Delta E \approx 35 - 50$  мэВ и определен нижний порог расположения уровня ЯТЦ:  $\sim 0,2$  эВ выше дна зоны проводимости.

Авторы благодарны Б.А. Волкову за обсуждение результатов.

#### Литература

1. Вул Б.М., Воронова И.Д., Калюжная Г.А., Мамедов Т.С., Рагимова Т.Ш. Письма в ЖЭТФ, 1979, **29**, 21.
2. Zasavitsky I.I., Matsonashvili B.N., Flusov G.V. Lecture Notes in Physics, 1982, **152**, 449.
3. Penchina C.M., Klein A., Weiser K. J. Phys. Soc. Japan (Suppl. A), 1980, **49**, 783.
4. Волков Б.А., Панкратов О.А. ДАН СССР, 1980, **255**, 93.
5. Вул Б.М., Гришечкина С.П., Рагимова Т.Ш. ФТП, 1982, **16**, 1452.